

大型真空蒸着装置 ED-3500



高真空蒸着装置ED-3500はプラスチック材料に光学膜を着けるために開発されたものですが、光学膜以外の使用も可能です。イオンレーティング用の直流電源及び高周波電源が標準装備されています。光学式と水晶式の2種類の膜厚モニターが用意されています。排気系はクライオポンプによるドライ排気です。

大型真空蒸着装置ED-3500仕様

- 到達圧力 ×10⁻⁵Pa以下※常温・無負荷・脱ガス時
- 真空室径 φ900mm×950mmH SUS304 電解研磨
- 蒸着機構 電子銃電源:JST-10F(JEOL製)
電子銃ルツボ:EBG-102UB4S(JEOL製)
ルツボ个数:4個
抵抗加熱最大電力:AC10V400A
抵抗電極数:2対(ポート)
- 基板形状 φ120mm 8~12枚
- 基板回転 ドーム形状:φ720mm
磁気シール駆動方式 0~30rpm
- 基板加熱 マイクロシースヒーター
常温~350℃迄昇温可能
制御方式:サイリスタ制御・PID方式デジタル温調計
- 膜厚計 光学式膜厚計・水晶振動式膜厚計
- 真空排気系 油回転ポンプ:1800L/min[60Hz]×2台
クライオポンプ:4000L/sec
- 真空計 大気圧検知器/ピラニ真空計/電離真空計
- 操作方法 排気系全自動(手動操作も可)
- ユーティリティ電気:AC200V三相35KVA
冷却水:25L/min以上0.2MPa以上0.25MPa以下25℃以下循環
計装エア:0.5MPa以上
設置寸法:3500mmW×3900mmD×2600mmH